



多晶硅片反应离子刻蚀制绒后扩散工艺的匹配性

豆维江¹, 秦应雄^{1,2}, 巨小宝¹, 李锴¹, 徐挺¹

1. 西安黄河光伏科技股份有限公司, 西安 710043;
2. 华中科技大学 光学与电子信息学院, 武汉 430074

Diffusion Processing and Its Matching Property of Multicrystalline Silicon Solar Cells Through Reactive Ion Etching Texturing

DOU Wei-jiang¹, QIN Ying-xiong^{1,2}, JU Xiao-bao¹, LI Kai¹, XU Ting¹

1. Xi'an Hanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd, Xi'an 710043, China;
2. School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(10\)](#)[相关文章\(15\)](#)